



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

## 片层界面择优定向的 $\gamma$ -TiAl合金细小全片层组织制备方法

文献类型: 专利

**作者** 刘仁慈、刘冬、崔玉友、杨锐

**发表日期** 2016-11-23

**专利国别** 中国

**专利类型** 发明

**权利人** 刘仁慈、刘冬、崔玉友、杨锐

**中文摘要** 片层界面择优定向的 $\gamma$ -TiAl合金细小全片层组织制备方法

**公开日期** 2016-11-23

**申请日期** 2014-01-24

**语种** 中文

**专利申请号** 201410038402.0

**源URL** [<http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/78849>]

**专题** 金属研究所\_中国科学院金属研究所

**推荐引用方式** 刘仁慈、刘冬、崔玉友、杨锐. 片层界面择优定向的 $\gamma$ -TiAl合金细小全片层组织制备方法. 2016-11-23.

**GB/T 7714**

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览	下载	收藏
159	0	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。